

맞춤형 Ptfе 실험실 세척 바스켓 캐리어 고순도 내산성 내알칼리성 웨이퍼 홀더 낮은 백그라운드 오염 방지 화학 배스 랙

품목 번호: PL-CP268



소개

반도체 및 미량 분석을 위해 설계된 고순도 맞춤형 PTFE 세척 바스켓 캐리어를 만나보세요. 이 내산성 랙은 용출 제로와 초저 백그라운드 수준을 보장하여 정밀 실험실 세척 공정을 위한 가장 까다로운 화학 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 웨이퍼 세척	클린룸 환경에서 RCA 세척 또는 HF 에칭 공정 중 실리콘 웨이퍼를 안전하게 고정합니다.	금속 오염을 방지하고 균일한 화학적 노출을 보장합니다.
미량 금속 분석	ppt 수준의 순도에 도달하기 위한 ICP-OES 및 ICP-MS 시료 준비에 사용되는 실험 기구의 세척 및 침출.	용기 재료 자체의 백그라운드 간섭을 제거합니다.
배터리 연구	전해질 침지 또는 화학 처리 단계에서 양극 및 음극 재료를 취급합니다.	공격적인 유기 용제 및 리튬 염에 대한 내성.
제약 멸균	고온 또는 화학적으로 공격적인 멸균 사이클을 통해 유리 바이알 또는 정밀 부품을 운반합니다.	순도를 유지하고 활성 성분의 표면 흡착을 방지합니다.
항공우주 부품 탈지	강력한 산업용 탈지제에서의 정밀 가공 합금 부품 세척 사이클 중 고정.	산업용 강도의 세척 시약에서의 장기적인 내구성.
태양 전지 제조	습식 화학 공정 및 텍스처링 단계에서 광전지 기판을 지지합니다.	에칭제에 대한 높은 내열성 및 화학적 호환성.
지질 시료 준비	원소 결정을 위해 농축 불산(HF)을 사용하여 광물 시료를 분해하고 세척합니다.	용기 열화 없이 위험한 산성 환경에서 안전한 취급.

사양 범주	PL-CP268 매개변수 세부 정보	값 / 성능
재료 특성	주요 구조 재료	버진 고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
	미량 원소 백그라운드	초저 (PPT 수준 분석에 적합)
	화학적 내성	범용 (용융 알칼리 금속/불소 제외)
	흡수율	<0.01%
물리적 치수	구성	고객 사양에 따라 완전 맞춤화 가능
	크기 옵션	2", 4", 6", 8", 12" 웨이퍼 또는 맞춤형 실험 기구를 위한 맞춤형 설계
	취급 기능	선택 사항인 통합 핸들, 확장 가능한 암 또는 잠금 뚜껑
열 제한	최대 작동 온도	260°C (500°F)
	최소 작동 온도	-200°C (-328°F)
제조 세부 사항	제조 방법	고정밀 CNC 가공
	표면 거칠기	Ra 0.4 - 0.8 µm (표준) / 연마 옵션 가능

사양 범주	PL-CP268 매개변수 세부 정보	값 / 성능
	품번 참조	PL-CP268